

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

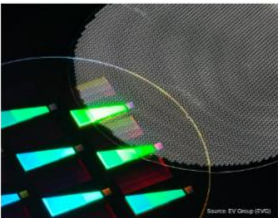
EVG introduced the EVG@7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. Supporting wafer sizes up to 300 mm and featuring high-precision alignment, advanced process control and high throughput, the EVG7300 meets the high-volume manufacturing needs for a variety of freeform and high-precision nano- and micro-optical components and devices. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.

HOME > 경제&산업 > 산업기자
EV 그룹, 대량생산 광학 기기 제조용으로 뛰어난 유연성을 제공하는 다기능 마이크로 및 나노임프린트 솔루션 'EVG@7300' 출시
 △ 이투뉴스 기자 | © 승인 2022.01.19 10:00 | 0 댓글



MBSE, 나노 기술 반도체 제조를 획기적 본딩 및 리소그래피 장비의 선도적 공급사인 EV 그룹(이하 EVG)은 자동화된 SmartNIL용 나노임프린트 및 웨이퍼 레벨 광학 시스템인 EVG@7300을 출시한다고 밝혔다. EVG의 최신 솔루션인 EVG7300은 나노임프린트 리소그래피(NIL), 렌즈 몰딩 및 렌즈 스택킹(LV 본딩) 같은 UV 기반의 여러 프로세스를 단일 플랫폼에 결합한 것이 특징이다. 이 산업용 다기능 시스템은 마이크로 및 나노 피팅은 물론 기능 웨이퍼 적층 등을 포함하는 광범위한 신규 애플리케이션의 첨단 R&D와 생산 공정에 모두 사용될 수 있다. 이러한 애플리케이션의 사례에는 웨이퍼 레벨 광학(WLO), 정확 센서와 프로젝터, 차량용 조명, 중앙 원시(AR) 헤드셋용 웨이퍼기판, 바이오 의료 장비, 메타 렌즈와 메타 표면, 굴절률 기기 등이 포함된다. 최대 300mm 웨이퍼까지 지원하고 고정밀 할라민엔트, 할라민 프로세스 제어, 우수한 스프레드 성능을 자랑하는 EVG7300은 다양한 자유도와 높은 정밀도로 나노 및 마이크로 광학 부품과 기기를 대량 생산하고자 하는 사용자의 요구를 충족한다.

EV 그룹의 톰라스 글린스너(Thomas Glöner) 기술담당 디렉터는 "나노임프린트 기술에 있어 세 20년 이상의 경험을 보유한 EV 그룹은 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위한 지속적인 기술 혁신을 통해 이 나노 솔루션을 개발하고 있다. 최신 나노임프린트 솔루션인 EVG7300은 EVG 그룹의 SmartNIL 플랫폼 임프린트 기술에 렌즈 몰딩과 렌즈 스택킹을 단일 플랫폼에 결합하고 있으며 시장에서 가장 정밀한 할라민엔트와 광학 파라미터 제어기 통합인 시스템으로서, 고객이 연구개발과 양산 공정에 모두 사용할 수 있게 해주는 유연성은 유연성을 제공한다고 말했다.



EVG7300은 독립된 플랫폼에서 사용하거나, 또는 EVG의 HERCULES® UV-NIL 플랫폼에 하나의 모듈로 통합해 사용할 수 있다. EVG의 HERCULES® UV-NIL 플랫폼은 사용자의 특정 프로세스 요인에 따라서 세팅과 레지스트 코팅 및 베이킹 같은 전체의 공정이나 후처리 공정을 추가할 수 있다. 또한 EVG7300은 얇게 선도적인 할라민엔트 광학도를 제공한다(300nm까지). 이는 할라민 엔트 할라민엔트 스텝이, 고정밀 광학계, 할라민엔트 및 웨이퍼 레벨 광학, 할라민엔트 프로세스 제어 등 다양한 광학의 적용 측면에 가능케한 것이다. 또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 플랫폼으로서, 세 가지 공정 모드(렌즈 몰딩, 렌즈 스택킹, SmartNIL) 나노임프린트를 지원하고 150mm부터 300mm까지 이르는 웨이퍼 크기를 지원한다. EVG7300은 신속한 스탬핑과 웨이퍼 본딩, 고속 할라민엔트 광학계 고정밀 광학, 스탬핑된 및 코팅된 렌즈 및 광학에서 사용과 메모리는 WLO 제품의 제조 요구를 충족하는 포괄적인 플랫폼을 제공한다.

이투뉴스 E2only

- 1. 해상도 높게, 자유곡면수용 임플란트...
- 2. 영구기 출구 밀면 갈수록 손해 보는...
- 3. 수소 투과율 낮춰 화제되고 고집...
- 4. SMPAC 통합상에 한층 시장 확대...
- 5. 한수원 후산 안전장치 승진 장비 자...
- 6. 대항전선, 싱가포르 400MW 조달계약...
- 7. 핵발전량 증대, 중국 선전군정체와 사...
- 8. 이라크의 탈레반 40% 가중치 30%...
- 9. [기타] 신우 올린 화보가산화...
- 10. 화력발전 4년 안팎, 강유나미전 송수...

GS EPS

SAMSUNG 삼성화재

무담배시 3% 적립